



圧電デバイスや微細流体回路の研究開発に

卓上型プラズマ微細加工装置

安価で、卓上サイズの
プラズマ加工装置をまもなく発売

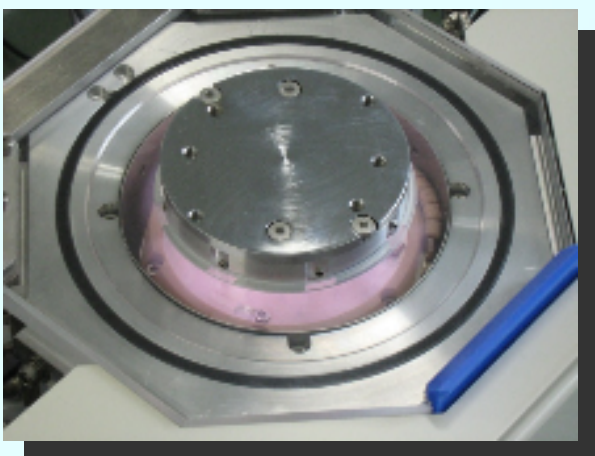


卓上型プラズマ微細加工装置外観

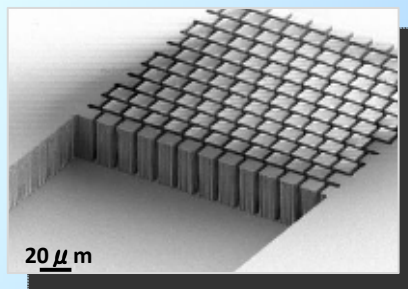
標準仕様

プラズマ生成方式	磁場支援容量結合型
チャンバー内寸	Φ150 mm×120H 上部蓋: 石英製
基板サイズ	最大Φ3インチ
ステージ冷却	空冷方式
主排気ポンプ	ターボ分子ポンプ 50 L/sec
メインバルブ	ハンピホイール式ゲートバルブ
高周波電源	13.56 MHz Max 100 W 手動整合方式
プロセスガス導入系	ニードルバルブ付フロート式流量計 標準2系統
真空計	ピラニー真空計 キャパシタンスマノメータ
外形寸法	装置本体部: 550W×540D×570H
オプション	マスフローコントローラー 高周波用自動整合器 電離真空計など

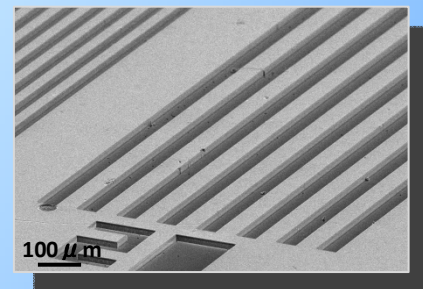
エッチング参考例(当社TEP-01にて加工)



プラズマ生成部



アクリル
流路幅: 200μm ピラー: □13.5μm
ピッチ: 3.2μm 深さ: 36μm



石英
ライン: 50μm 深さ: 12μm

立山科学グループ
立山マシン株式会社 技術本部

〒930-1305 富山県富山市下番30

TEL: 076-483-3088 FAX: 076-483-3089

Web: <http://www.tateyama.jp/>

E-Mail: tech@tateyama.or.jp

